

## ЕМКОСТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ ОБЛУЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ГЕРМАНИЙ—КРЕМНИЙ

Белокурова И. Н., Третьяк О. В., Шаховцова С. И.,  
Шварц М. М., Шматов А. А.

Методом DLTS исследованы облученные  $\gamma$ -квантами  $^{60}\text{Co}$  барьеры Шоттки, изготовленные на твердых растворах  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  ( $0 \leq x \leq 0.04$ ), легированных сурьмой. Получены основные параметры радиационных дефектов, изучены кинетика дефектообразования на начальных стадиях облучения и влияние отжига на термическую стабильность радиационных дефектов. Предложен новый метод обработки сложных спектров DLTS.

В настоящей работе продолжены начатые нами ранее исследования процессов дефектообразования в твердых растворах  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$   $n$ -типа проводимости [1, 2]. Методом емкостной спектроскопии на барьерах Шоттки, изготовленных на  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ , изучены кинетика образования радиационных дефектов (РД) на начальных стадиях облучения, их термическая стабильность, рассчитаны энергетическое положение и сечения захвата.

Из исследований эффекта Холла известно [2], что в  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  типичным при облучении является образование трех типов радиационных акцепторов ( $E'$ ,  $E''$ ,  $E'''$ ), определяющих процесс компенсации проводимости. Энергетическое положение и электрическая активность РД зависят от содержания кремния. Уровни  $E'$  (мелкий) и  $E''$  (более глубокий) расположены вблизи  $E_c - 0.2$  эВ, а  $E'''$  — в нижней половине запрещенной зоны и не виден из холловских измерений. С увеличением концентрации Si роль  $E'''$  в компенсации становится доминирующей. Термическая устойчивость РД  $E'$ ,  $E''$  и  $E'''$  соответствует температуре отжига 380, 430 и 500 К. Вопрос о природе РД в  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  является дискуссионным [1-3]. РД в  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  методом DLTS ранее не изучались.

Исследовались диоды с барьером Шоттки, изготовленные напылением тонкого слоя алюминия 0.15—0.2 мкм на монокристаллические подложки  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ , легированные сурьмой в концентрации  $4 \cdot 10^{14} \div 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ . Содержание кремния составляло  $0 \leq x \leq 4 \cdot 10^{-2}$ . Омический контакт наносился электролитическим осаждением золота с последующим его вжиганием в атмосфере водорода при 350 °С в течение 15 мин. Диоды облучались  $\gamma$ -квантами  $^{60}\text{Co}$  при мощности дозы 300 Р/с и температуре 40 °С. Отжиг проводился на воздухе при  $T = 430$  К.

Измерения DLTS проводились на разработанной нами автоматизированной установке, параметры которой аналогичны описанным в [4]. В качестве особенностей установки можно отметить отсутствие моста переменного тока, возможность при одном температурном сканировании устанавливать несколько «кокон эмиссии», использование в дискриминаторе биполярной прямоугольной весовой функции. Учитывая то, что прежде параметры радиационных дефектов в твердых растворах германий—кремний методом DLTS не определялись, обработку экспериментальных спектров DLTS проводили тремя способами: по температурной зависимости положений максимумов пиков при различных окнах эмиссии [5], по многим точкам кривой DLTS, снятой при одном температурном сканировании [6, 7], по предложенному нами методу моделирования. Первые два метода достаточно хорошо известны. Погрешности при определении параметров центров этими методами в значительной мере связаны с огра-

ниченными возможностями обработки перекрывающихся пиков, необходимостью многократного температурного сканирования для метода Лэнга [5] и трудностями точного определения амплитудного значения и положения по температуре максимума пика в методе [6, 7]. Предложенный нами метод лишен перечисленных недостатков и, кроме того, позволяет расширить возможности метода DLTS.

Рассмотрим общий случай для одновременно перезаряжающихся  $M$ -типов глубоких центров. Сигнал на выходе дискриминатора в этом случае, согласно [8], представим в виде

$$P = \frac{K}{T_m} \int_0^{T_m} \left[ \sum_{i=1}^M C_i \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right) + n(t) \right] \omega(t) dt, \quad (1)$$

где  $C_i$  — величина релаксирующей части емкости для  $i$ -го глубокого уровня,  $\tau_i$  — постоянная времени перезарядки  $i$ -го глубокого уровня,  $n(t)$  — любая искажающая функция (например, гауссовский шум),  $K$  — масштабный коэффициент,  $\omega(t)$  — весовая функция,  $T_m$  — характерное время выходного фильтра (время интегрирования).

Конкретная корреляционная весовая функция, которую мы использовали в измерениях DLTS, выглядит следующим образом:

$$\omega(t) = \begin{cases} 0, & nT < t < t_0 + nT, \\ 1, & t_0 + nT < t < 3t_0 + nT, \\ 0, & 3t_0 + nT < t < 5t_0 + nT, \quad T = 8t_0; \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ -1, & 5t_0 + nT < t < 7t_0 + nT, \\ 0, & 7t_0 + nT < t < 8t_0 + nT. \end{cases} \quad (2)$$

Окно эмиссии в этом случае равно  $3.537t_0$ . Подставив (2) в (1), получим выражение для сигнала DLTS

$$P = K \sum_{i=1}^M C_i \left( \frac{\tau_i}{2t_0} \right) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{2t_0}{\tau_i}\right) \right] \left[ \exp\left(-\frac{t_0}{\tau_i}\right) - \exp\left(-\frac{5t_0}{\tau_i}\right) \right] + Q, \quad (3)$$

где  $\tau_i = B_i^{-1} \exp(\Delta \mathcal{E}_i / kT)$ , для случая обмена  $i$ -го глубокого уровня с зоной проводимости  $B_i = N_c v_n \sigma_{n_i}$ , а для случая обмена  $i$ -го глубокого уровня с валентной зоной  $B_i = N_v v_p \sigma_{p_i}$ ,  $\Delta \mathcal{E}_i$  — энергетическое расстояние  $i$ -го глубокого уровня от края той разрешенной зоны, с которой обменивается данный уровень,  $\sigma_{n_i}$ ,  $\sigma_{p_i}$  — сечения захвата на  $i$ -й глубокий уровень электронов и дырок соответственно,  $v_n$ ,  $v_p$  — тепловая скорость электронов и дырок соответственно,  $Q$  — величина, не зависящая от температуры, часто пренебрежимо мала.

Для вычисления величин  $C_i$ , которые связаны с концентрациями соответствующих глубоких центров, энергий  $\Delta \mathcal{E}_i$  и сечений захвата  $\sigma_{n_i}$  ( $\sigma_{p_i}$ ) произведем пошаговое сравнение экспериментальных и теоретических данных (метод последовательных приближений [9]). В общем виде запишем

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |P(j) - Y(j)| = S_k, \quad (4)$$

где  $V(j)$ ,  $P(j)$  — соответственно экспериментальное и теоретическое значения сигнала DLTS при  $j$ -й температуре,  $N$  — количество экспериментальных точек (температур),  $S_k$  — погрешность совпадения в  $k$ -м шаге,  $k$  — номер текущего шага.

Последовательно варьируя определяемые и приближенно заданные параметры по наискорейшему спуску, минимизируем  $S_k$ . Вычисления циклически повторяются с уменьшающимся шагом до определенного предела, ограниченного точностью измеренных величин и другими погрешностями.

Аналогично можно вычислить из спектра температурную зависимость сечения захвата. Для этого достаточно избавиться от приближения  $\sigma = \text{const}$  и для каждой температурной точки вычислить  $\sigma$ .

На рис. 1 приведены типичные спектры DLTS в области температур 77—300 К для образцов  $Ge_{1-x}Si_x$  с различным содержанием кремния, облученных дозой  $5 \cdot 10^7$  Р, при величине обратного смещения 2 В и окне эмиссии  $7.9 \cdot 10^{-4}$  с. В таблице приведены результаты обработки спектров DLTS тремя способами ( $E$  — энергия активации,  $\sigma_{n,p}$  — сечение захвата электронов, дырок). При варьировании окон эмиссии вид спектра изменялся. В случае разделяющихся пиков все три метода дают совпадающие в пределах погрешности значения энергетического положения и величин сечений захвата уровней РД. В случае перекрывающихся пиков предложенный нами метод имеет значительные преимущества: по сравнению с методом Лэнга [5] не требуется многократного температурного сканирования, по сравнению с методом [6, 7] имеется достаточно эффективный и простой алгоритм расчета.

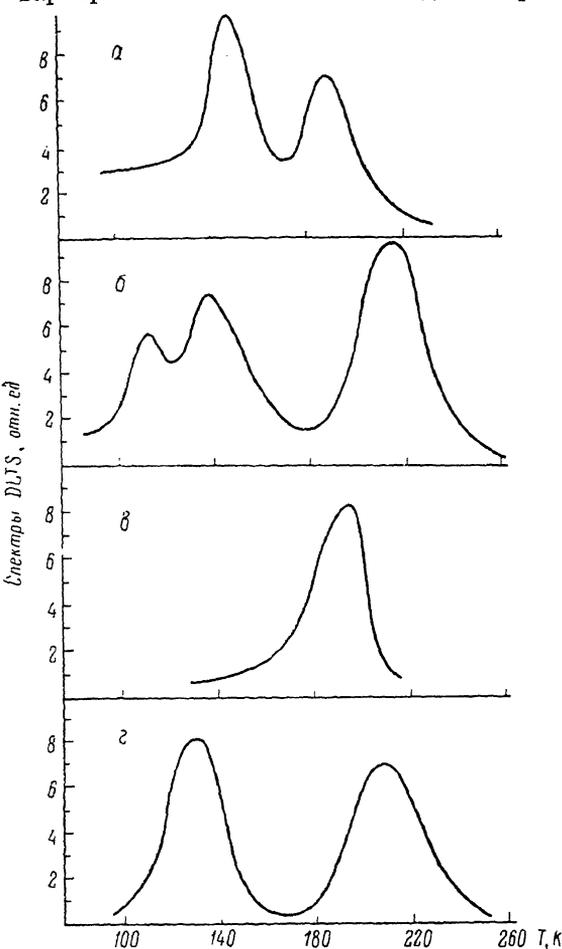


Рис. 1. Спектры DLTS для образцов  $Ge_{1-x}Si_x$ , облученных дозой  $\Phi_\gamma = 5 \cdot 10^7$  Р, при величине обратного смещения 2 В и «окне эмиссии»  $7.9 \cdot 10^{-4}$  с.

x: а — 0, б —  $1 \cdot 10^{-4}$ , в —  $3 \cdot 10^{-2}$ , г —  $4 \cdot 10^{-2}$ .

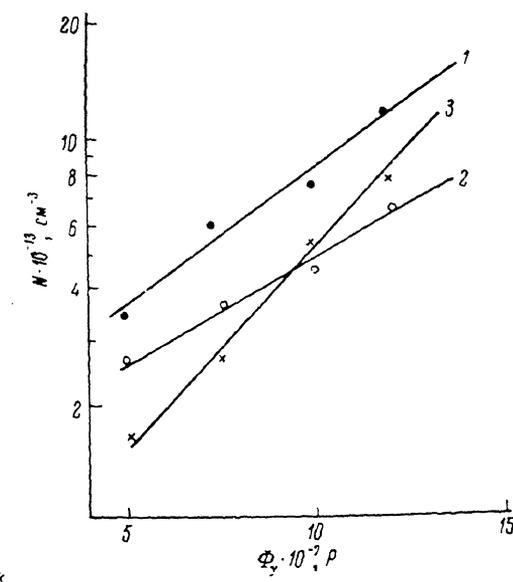


Рис. 2. Дозовые зависимости концентрации уровней РД в  $Ge_{1-x}Si_x$  с  $x = 4 \cdot 10^{-2}$ .

1 —  $E_c - 0.15$ , 2 —  $E_c - 0.28$ , 3 —  $E_v + 0.19$  эВ.

Согласно результатам исследований твердых растворов  $Ge_{1-x}Si_x$  методами DLTS и Холла [1, 2], проведена идентификация уровней РД  $E'$  и  $E''$ . С увеличением содержания кремния от  $1 \cdot 10^{-4}$  до  $4 \cdot 10^{-2}$  положение более мелкого уровня  $E'$  изменяется от 0.18 до 0.13 эВ, а более глубокого  $E''$  — от 0.21 до 0.27 эВ (см. таблицу).

Концентрация уровней РД в  $Ge_{1-x}Si_x$  возрастает с увеличением дозы облучения. Типичные дозовые зависимости приведены на рис. 2 для  $Ge_{0.96}Si_{0.04}$ . На начальной стадии облучения ( $5 \cdot 10^7 < \Phi_\gamma < 1.2 \cdot 10^8$  Р) наиболее эффективно вводятся РД типа  $E''$ . Начальные скорости введения РД уменьшаются в  $Ge_{1-x}Si_x$  с увеличением содержания Si, например  $dN^I/d\Phi_\gamma$  и  $dN^{II}/d\Phi_\gamma$  равны соответственно  $4.7 \cdot 10^{-4}$  и  $8.2 \cdot 10^{-4}$  см<sup>-1</sup> при  $x=0$ ;  $2.8 \cdot 10^{-4}$  и  $4.5 \cdot 10^{-4}$  см<sup>-1</sup> при  $x=0.04$ .

Материал, ат% Si	Метод Лэнга [5]		Метод [7]		Метод, предложенный в настоящей работе	
	$E \pm 0.01$ эВ	$\sigma_{n, p}, \text{см}^2$	$E \pm 0.01$ эВ	$\sigma_{n, p}, \text{см}^2$	$E \pm 0.01$ эВ	$\sigma_{n, p}, \text{см}^2$
Ge	$E_c - 0.22$	$\sigma_n = 2.4 \cdot 10^{-17}$	$E_c - 0.21$	$\sigma_n = 1 \cdot 10^{-17}$	$E_c - 0.23$	$\sigma_n = 8 \cdot 10^{-18}$
	$E_c - 0.27$	$\sigma_n = 4 \cdot 10^{-17}$	$E_c - 0.27$	$\sigma_n = 5.3 \cdot 10^{-17}$	$E_c - 0.27$	$\sigma_n = 7.6 \cdot 10^{-17}$
	$E_v + 0.14$	$\sigma_p = 4 \cdot 10^{-18}$	—	—	$E_v + 0.15$	$\sigma_p = 3 \cdot 10^{-17}$
	$E_v + 0.22$	$\sigma_p = 3 \cdot 10^{-18}$	—	—	$E_v + 0.22$	$\sigma_p = 1.7 \cdot 10^{-16}$
Ge—Si (0.01)	$E_c - 0.18$	$\sigma_n = 2 \cdot 10^{-15}$	—	—	$E_c - 0.19$	$\sigma_n = 8.7 \cdot 10^{-16}$
	$E_c - 0.21$	$\sigma_n = 1 \cdot 10^{-14}$	—	—	$E_c - 0.22$	$\sigma_n = 6.3 \cdot 10^{-14}$
	$E_c - 0.37$	$\sigma_n = 2 \cdot 10^{-15}$	—	—	$E_c - 0.36$	$\sigma_n = 2.3 \cdot 10^{-15}$
	$E_v + 0.23$	$\sigma_p = 4.5 \cdot 10^{-16}$	—	—	$E_v + 0.25$	$\sigma_p = 1.9 \cdot 10^{-15}$
Ge—Si (3.0)	$E_c - 0.21$	$\sigma_n = 1.7 \cdot 10^{-17}$	$E_c - 0.16$	$\sigma_n = 6 \cdot 10^{-20}$	$E_c - 0.18$	$\sigma_n = 2 \cdot 10^{-19}$
	—	—	$E_c - 0.22$	$\sigma_n = 4.7 \cdot 10^{-18}$	$E_c - 0.23$	$\sigma_n = 4 \cdot 10^{-18}$
Ge—Si (4.0)	$E_v + 0.21$	$\sigma_p = 3 \cdot 10^{-17}$	—	—	$E_v + 0.2$	$\sigma_p = 3 \cdot 10^{-16}$
	$E_c - 0.13$	$\sigma_n = 2 \cdot 10^{-20}$	$E_c - 0.14$	$\sigma_n = 2.2 \cdot 10^{-19}$	$E_c - 0.15$	$\sigma_n = 2.1 \cdot 10^{-19}$
	$E_c - 0.26$	$\sigma_n = 5 \cdot 10^{-19}$	$E_c - 0.26$	$\sigma_n = 3.6 \cdot 10^{-17}$	$E_c - 0.28$	$\sigma_n = 3.2 \cdot 10^{-17}$
	$E_v + 0.18$	$\sigma_p = 5.5 \cdot 10^{-17}$	—	—	$E_v + 0.19$	$\sigma_p = 1 \cdot 10^{-17}$

Термическая устойчивость уровней РД  $E'$  и  $E''$  соответствует стадиям изохронного отжига 380 и 430 К. Уровни  $E'$  и  $E''$  отжигаются при температуре 430 К в Ge, облученном дозой  $1.2 \cdot 10^8$  Р, в течение 1.5 ч, а в  $\text{Ge}_{0.96}\text{Si}_{0.04}$  — 3 ч.

После отжига РД  $E'$  и  $E''$  в спектре Ge наблюдаются уровни  $E_v + 0.14$  и  $E_v + 0.22$  эВ. Согласно [10], РД с близким к  $E_v + 0.14$  эВ значением энергии активации обладает донорными свойствами. В  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  после отжига наблюдаются только РД с уровнем, на  $\sim 0.2$  эВ превышающим потолок  $\nu$ -зоны. Энергия активации этого уровня уменьшается от  $E_v + 0.25$  до  $E_v + 0.19$  эВ при изменении  $x$  от  $1 \cdot 10^{-4}$  до  $4 \cdot 10^{-2}$  соответственно. Величины концентрации, скорости введения, вид дозовой зависимости (рис. 2), термическая стабильность позволили идентифицировать его с уровнем РД типа  $E'''$ .

Анализ полученных результатов показал существенное уменьшение сечения захвата центров  $E'$  и  $E''$  (на 3—4 порядка) при увеличении содержания Si от 0.01 до 3—4 ат%. Столь малые сечения захвата для электронов могут быть связаны, например, с ростом отрицательного заряда центров. Изменение положения  $E'$  и  $E''$  с ростом  $x$  (уровни смещаются в противоположные стороны и степень заполнения их должна изменяться противоположным образом), а также отсутствие заметной температурной зависимости  $\sigma$  (по результатам расчета по третьей методике) исключают многозарядовую природу центров. Это свидетельствует в пользу образования сложных комплексов с участием Si. Такое заключение не противоречит нашим выводам [1, 2, 11] о возрастающей роли электрических полей неоднородностей, связанных с увеличением степени деформации решетки твердого раствора при введении кремния и с особенностями структуры РД.

Таким образом, в работе предложен новый метод обработки сложных спектров DLTS, имеющий ряд преимуществ по сравнению с известными ранее. Определены параметры уровней РД. Получены факты, свидетельствующие о наличии полей неоднородностей, связанных с деформацией решетки  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  при введении Si и РД.

Авторы выражают благодарность Р. В. Конаковой за помощь в изготовлении барьеров Шоттки.

#### Список литературы

- [1] Shahovtsova S. I., Belokurova I. N., Shahovtsov V. I. // Sol. St. Commun. 1982. V. 44. N 8. P. 1169—1174.
- [2] Шаховцова С. И., Шварц М. М., Белокурова И. Н., Хавжу Д. М. // УФЖ. 1985. Т. 30. В. 4. С. 582—585.
- [3] Cleland J. W., James F. J., Westbrook J. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 1975. V. NS-22. P. 2289—2294.

- [4] Wang K. L. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53. N 1. P. 449—453.  
[5] Lang D. V. // J. Appl. Phys. 1974. V. 45. N 7. P. 3023—3032.  
[6] Bloa A. L., Favennic H. N., Colin J. // Phys. St. Sol. (a). 1981. V. 64. N 1. P. 85—91.  
[7] Васильев А. В., Смагулова С. А., Шаймеев С. С. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 1. С. 162—164.  
[8] Miller G. L., Ramires J. V., Robinson D. A. // J. Appl. Phys. 1975. V. 46. N 6. P. 2638—2644.  
[9] Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кабельков Г. И. Численные методы. М., 1987. 600 с.  
[10] Комаров Б. А., Латышев А. В., Ткачев В. Д. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 3. С. 522—525.  
[11] Shahovtsova S. I., Shahovtsov V. I., Belokurova I. N. // Sol. St. Commun. 1982. V. 41. N 4. P. 269—272.

Киевский

государственный университет им. Т. Г. Шевченко

Получена 17.04.1989

Принята к печати 9.06.1989